【実習プログラム案】

2013年8月29日（木曜） 1日目

13時20分集合 （NMEMSイノベーション棟1F受付ロビー或いは、2F会議室）：入所方法、集合場所等は参加者に別途ご案内致します。

1）13:20-13:25　開催の挨拶（人材育成委員会・前田龍太郎委員長ご挨拶）
2）13:25-13:40　オリエンテーリングとMNOICの概要説明（担当 三原）
3）13:40-14:30　MemsONE（統合化MEMS設計・シミュレーションツール）の紹介
「どんなシステム、何が出来るの？どこが凄いの？」（みずほ情報総研 浅海氏）
4）14:40-17:30　MemsONEによるナノインプリント形状予測シミュレーション実習
「温度、圧力を変えた場合の変形ダイナミックスの計算」（浅海氏、水津、三原）
5）17:30-18:30　簡単な懇親会 （参加者＋関係者：ビールとおつまみ程度）

MemsONE* 正式名称：MEMS用設計・解析支援システム

2013年8月30日（金曜） 2日目

1）9:00　集合 （NMEMSイノベーション棟2F会議室）
2）9:00-10:00　Obducat社製ナノインプリント装置の原理・装置の特徴や有効性
（アペックス社 松本健様）
3）10:00-10:45　ナノインプリント技術の最前線と、具体的な応用事例
（産総研・集積マイクロシステム研究センター 廣島副センター長）
4）10:45-12:00　Obducat社製ナノインプリント装置の操作方法の実習 （上野）
5）13:00-14:30　ナノインプリント装置を用いた、8インチ金型による転写実習 （上野）
6）14:30-15:20　光学式干渉計を用いた表面形状の計測 （上野）
7）15:30-16:00　MemsONEによるシミュレーション結果と、実測値の比較および考察 （上野、三原）
8）16:00-16:30　纏めと反省会 （三原、上野、原田）
9）16:30　終了予定